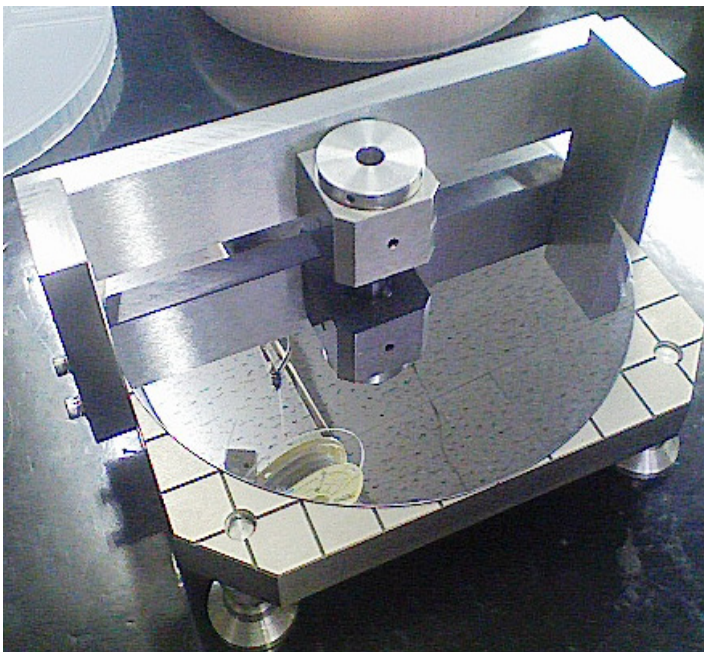


## ウェハー厚さ測定器 参考出品

### 概要

最近、小口径対応のウェハー厚さ測定器が減る中、希望の仕様に合わせた、システムを構築して、提案させていただきます。手動機から、全自動機迄、柔軟に対応いたします。  
静電容量式変位センサーによるウェハーの厚み測定を基本に、搬送機及び自動ステージを組み合わせる事によりジオメトリックな3次元形状のプロファイリングが可能。高度に安定化された静電容量変位センサーは高い分解能と優れた再現性を両立しています、また電極面積の選択と測定ギャップの柔軟な設定により高度に平坦化されたウェハーにも、配線後のワープの大きな測定サンプルにも最適な測定系が構築可能です。

### 装置イメージ

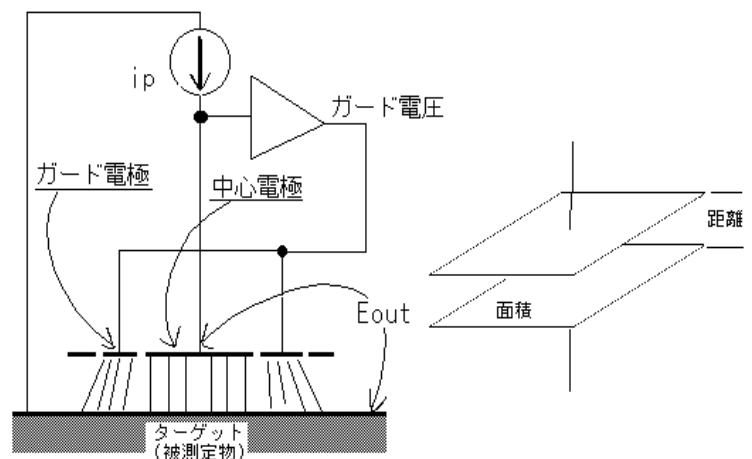


操作简单

高精度

短時間検査

### 動作原理解説



### 特徴

近似的な、平行板コンデンサーに交流定電流を流し、距離の絶対値に比例した交流電位が発生する原理を、利用している為、出力に直線性が得られ誤差となる、リニアライザーを使用していません。  
等電位ドライブにより、プローブや、ケーブルの静電容量をキャンセルしています。  
測定サンプルに、導電性が有れば、材質に左右されずに正確な、測定が可能です。

### 理論的な分解能

条件：ワークが静止状態。  
ベースプレートに載っている（静電容量の結合で接地が効いている）状態。  
中点付近でDVM受け。

- 500  $\mu\text{m}/\text{FS}$  のプローブ使用時に 500msec 積分で 30 nm、
- 1000  $\mu\text{m}/\text{FS}$  のプローブ使用時に 500msec 積分で 60 nm
- 接近側で、500  $\mu\text{m}/\text{FS}$  : 20 nm : 1000  $\mu\text{m}/\text{FS}$  : 40 nm